

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

6018936

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 62088526 A2 870423 <No. of Patents: 002>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 62088526	A2	870423	JP 85229289	A	851014 (BASIC)
JP 94006248	B4	940126	JP 85229289	A	851014

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 85229289 A 851014

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 62088526 A2 870423

X-Y STAGE (English)

Patent Assignee: OMRON TATEISI ELECTRONICS CO

Author (Inventor): TSUTSUI KEIICHI; SUYAMA SADA0; KOSHIBA YOSHIHITO

Priority (No,Kind,Date): JP 85229289 A 851014

Applic (No,Kind,Date): JP 85229289 A 851014

IPC: * B23Q-001/18; G01B-005/00; G01B-021/00; H01L-021/68

Derwent WPI Acc No: * G 87-152858

JAPIO Reference No: * 110296M000033

Language of Document: Japanese

Patent (No,Kind,Date): JP 94006248 B4 940126

Patent Assignee: OMRON TATEISI ELECTRONICS CO

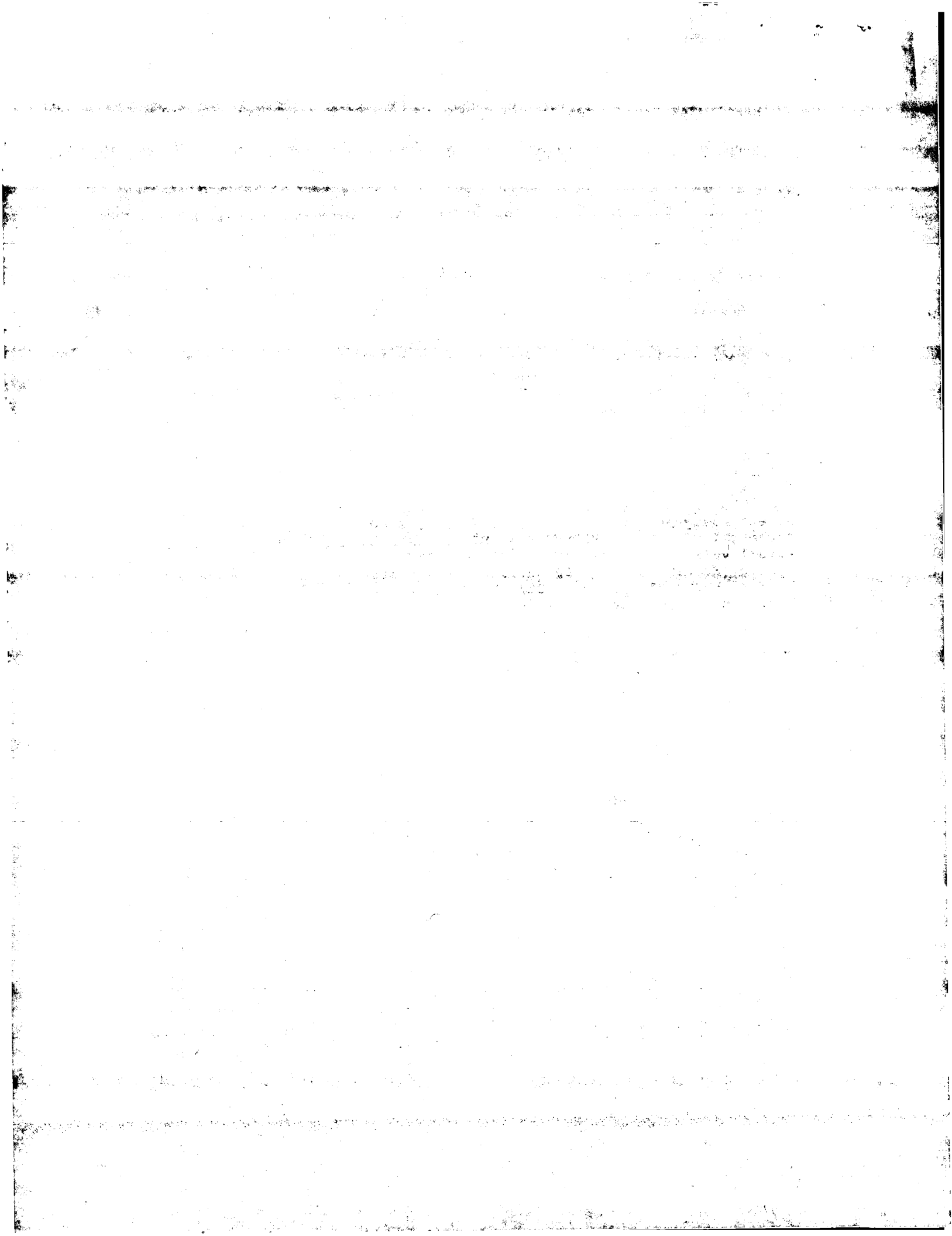
Author (Inventor): TSUTSUI KEIICHI; SUGYAMA SADA0; KOSHIBA YOSHIHITO

Priority (No,Kind,Date): JP 85229289 A 851014

Applic (No,Kind,Date): JP 85229289 A 851014

IPC: * B23Q-001/18; H01L-021/027; H01L-021/68

Language of Document: Japanese



(19)日本国特許庁(JP)

(12)特 許 公 報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平6-6248

(24)(44)公告日 平成6年(1994)1月26日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 2 3 Q 1/18	A	8107-3C		
H 0 1 L 21/027				
21/68	K	8418-4M	H 0 1 L 21/ 30	3 0 1 Z
		7352-4M		3 1 1 L
		7362-4M		発明の数1(全 5 頁)

(21)出願番号 特願昭60-229289

(22)出願日 昭和60年(1985)10月14日

(65)公開番号 特開昭62-88526

(43)公開日 昭和62年(1987)4月23日

(71)出願人 999999999

オムロン株式会社

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

(72)発明者 筒井 敬一

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 立
石電機株式会社内

(72)発明者 杉山 定夫

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 立
石電機株式会社内

(72)発明者 小柴 美仁

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 立
石電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 由充

審査官 豊原 邦雄

(56)参考文献 特開 昭60-127932 (JP, A)

特開 昭56-17341 (JP, A)

(54)【発明の名称】 XYステージ

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】上面に摺動面を形成した定盤と、この定盤の周辺に各々平行配備された一対のX軸ガイドおよびY軸ガイドと、平行する一対の真直ガイド部材を有し両端を対向するX軸ガイドに往復動可能に支持したX軸可動ガイドと、軸身部に互いに対向して長孔を形成した平行する一対の真直ガイド部材を有し、前記X軸可動ガイドに対し長孔を貫通させ両端をY軸ガイドに往復動可能に支持したY軸可動ガイドと、両可動ガイドの交叉部においてX軸、Y軸方向に互いに平行したガイド部材に摺動可能に支持された自在ステージとを具備して成るXYステージ。

【請求項2】X軸可動ガイドとY軸可動ガイドの可動位置高さ、および、両可動ガイドの可動位置高さと自在ステージの重心位置高さが同一高さに設定されている特許

2

請求の範囲第1項記載のXYステージ。

【発明の詳細な説明】

<産業上の利用分野>

この発明は精密工作機、ロボット、精密測定機、半導体製造装置等に適用し、精密な位置決めを行う移動テーブル装置、所謂XYステージに関する。

<発明の概要>

この発明は、定盤上にX軸方向、Y軸方向に往復動する可動ガイド、および両可動ガイドの交叉部に自在ステージを配備したXYステージであって、X軸可動ガイドおよびY軸可動ガイドをそれぞれ平行する一対の真直ガイド部材にて構成し、XY何れか一方の可動ガイドの軸身部に長孔を開設して他方の可動ガイドを直交して貫通させ、その交叉部においてX軸、Y軸方向に互いに対向した真直ガイド部材に対し自在ステージを支承して、両可

3

動ガイドの可動位置高さとステージの重心位置高さを完全同一となすことにより、ステージの走り特性、応答性を向上し且つ組立、調整作業の簡易化を実現したものである

<発明の背景>

従来この種XYステージは、第4図乃至第6図に示す如く、定盤7上にX軸方向、Y軸方向に往復動するX軸可動ガイド8a、Y軸可動ガイド8bを立体交叉して配備し、その交叉部に自在ステージ9を移動自在に支持している。この自在ステージ9には、上下に変位をずらせて直交する案内溝91、92を形成し、これにX軸可動ガイド8a、Y軸可動ガイド8bを軸受機構93を介して摺動自在に軸承し、斯るステージ9のテーブル94上に、ウエハ駆動機構95を備えたウエハステージ96を搭載している。ところが、上記構造のXYステージでは、自在ステージ9に対し、XY可動ガイド8a、8bが立体交叉して貫通するため、ウエハステージ96およびその駆動機構95、L形ミラ97等はテーブル94上に搭載することが不可欠となり、従って、XY可動ガイド8a、8bの可動位置の相違および両可動ガイドの可動位置に対する自在ステージ9の重心位置が高位置となることによって、移動時のビッチング運動が大となり、走り特性の劣化を招くと共に、ビッチング運動が抑まるまで位置決め整定できないため、ステップ動作における位置決め整定に長時間を要す不利を生じている。しかも、XY可動ガイド8a、8bの直交調整が困難であり、特にXY可動ガイド8a、8bとステージ9との間には8個の軸受機構93が設けられ、各軸受機構93は相対関係をもつため組立て調整が複雑である。つまり、8個の軸受機構93を総て均等に作動すべく組立てることが困難なため、XY可動ガイド8a、8bに対しステージ9が不均等に支持され、これがヨーイング、ビッチングのおおきき原因にもなっている。更に前記各軸受機構93の取付け、軸受すきまの調整作業はステージ上のテーブル94を取外した状態で行われるため、ステージ最終使用状態のもとで、軸受すきまを設定することが出来ない等、多くの問題があった。

<発明の目的>

この発明は極めて簡単な構成によってXY可動ガイドの駆動位置高さおよびこの駆動位置高さとステージの重心位置高さを同一高さに設定し、ステージのヨーイング、ビッチング等を防止して走り特性、応答性を向上し且つ組立、調整作業の簡易化を実現した新規なXYステージを提供することを目的とする。

<発明の構成および効果>

上記の目的を達成するため、この発明では、定盤上にX軸方向、Y軸方向に往復動する可動ガイドおよび両可動ガイドの交叉部に自在ステージを配備したXYステージにおいて、X軸可動ガイドおよびY軸可動ガイドをそれぞれ平行する一対の真直ガイド部材にて構成し、何れか

4

一方の可動ガイドの軸身部に長孔を形成して他方の可動ガイドを直交して貫通させ、両可動ガイドの交叉部においてX軸、Y軸方向に互いに平行したガイド部材の対向面を案内面として自在ステージを摺動可能に支承して成る。

上記の構成によると、X軸可動ガイドとY軸可動ガイドの駆動位置高さ、および該可動位置高さとステージの重心位置高さを完全同一高さに設定できる。この結果、ステップ送り時の加速減速の際、ステージが滑り動作、つまりビッチングを起こすことがなくなる、という大きな効果が得られ、ステージの走り特性および応答性を向上し得る。しかも、XY可動ガイドの交叉部において、X軸、Y軸方向に互いに平行した真直ガイド部材の対向面を案内面としてステージを支承するため、ステージの上面へウエハ駆動機構、ウエハステージ、L形ミラー等を搭載した状態の俵、各軸受すきまを調整し得、以て、組立て作業、調整作業が一段と簡易となる。更に、平行した真直ガイドの内側寸法は、結合部材の部品長さによって定まり、結合部材の寸法精度を管理するだけで軸受すきまを同一寸法精度に組立調整できるため、生産性、組立性が大幅に向上する等、実用上の優れた効果を有す。

<実施例の説明>

第1図は本発明にかかるXYステージの平面図を示す。XYステージの定盤1は、上面に平坦な摺動面11を形成し、周辺に互いに平行したX軸ガイド12、12aおよびY軸ガイド13、13aを配備して、対向するガイド間にX軸可動ガイド2、Y軸可動ガイド3を往復摺動可能に支持している。両可動ガイド2、3は、各々一対の真直ガイド部材21、31をステージに応じて適当間隔に平行させ、両端を連結部材22、32にて一体結合している。両可動ガイド2、3の何れか一方、実施例ではX軸可動ガイド3における真直ガイド部材21、21の軸身部に対向した長孔24を形成し、この長孔24に対しY軸可動ガイド3を貫通して交叉させ、XY可動ガイド2、3の両端は、それぞれ軸受5を介して対向するX軸ガイド12、12a、Y軸ガイド13、13aに対し摺動可能に支持すると共に、各々連結部材22、32に移動子23、34、また、X軸ガイド、Y軸ガイドに固定子11、15を構成して往復駆動装置を構成している。前記XY可動ガイド2、3の交叉部に対し、X軸、Y軸方向に互いに平行したガイド部材21、21および31、31の対向面を案内面として自在ステージ4を支承している。

自在ステージ4は、前記交叉部における各ガイド部材の案内面に対向する角筒体41の上下に鈎壁42、43を設けてなり、このステージ4を軸受部材として交叉部における各ガイド部材21、31に摺動可能に支持すると共に、該ステージ4の角筒体41の内部にウエハ駆動機構44、この駆動機構44の上面にウエハステージ4

5

5、銅壁上にL形ミラー46を配備してなるものである。
 上記ステージ4は、摺動性を有す軸受材料にて構成するも可く、或いはまた、角筒体41および銅壁42、43に圧力空気源に連通する空気導孔を穿設して各ガイド部材21、31および定盤と対向する面に噴出口を開設し、ステージ4自体に空気軸受を構成するも可い。尤も別途空気軸受を取付けることも勿論可能である。本実施例では上記の如く、定盤1上に往復動可能に配備したX軸可動ガイド2、Y軸可動ガイド3を、各々平行する一対の真直ガイド部材21、31にて構成し、一方の可動ガイド2の軸身部に長孔24を形成して他方の可動ガイド3を直交して貫通させ、両可動ガイド2、3の交叉部に対し、X軸Y軸方向に互いに平行したガイド部材21、31の対向面を案内面として自在ステージ4を摺動可能に支持したから、両可動ガイド2、3の可動位置高さとステージ4の重心位置高さを全て同一高さに設定で

6

きるため、ステージ走行時のビッチングを一挙に解消し、走り特性、応答性を向上し得る。しかも、ウエハステージ45および駆動機構44を搭載した俥、軸受すきまを調整できる等、構成簡易にして発明目的を達成した効果を有す。

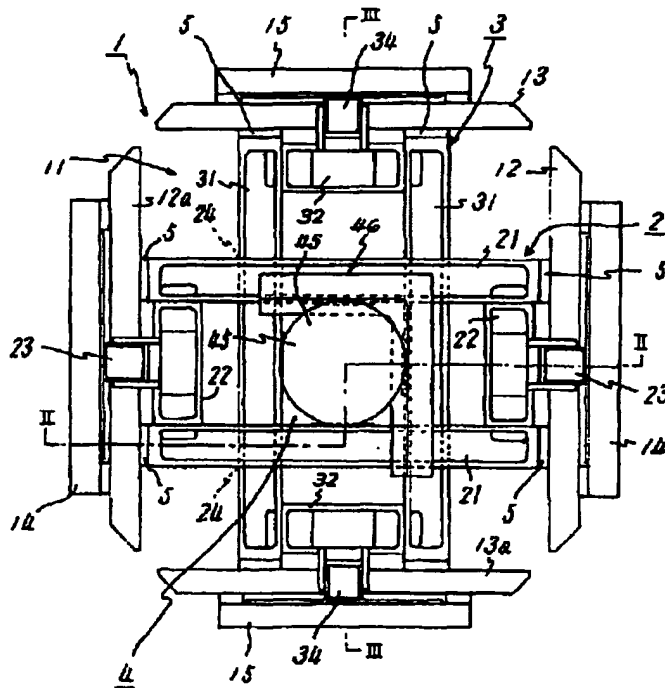
【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の一実施例にかかるXYステージの平面図、第2図は第1図II-II線断面図、第3図はIII-III線断面図、第4図は従来例の平面図、第5図はVI-VI線断面図、第6図は従来のXY可動ガイドの交叉部分の斜断面図である。

- | | |
|----------------|------------|
| 1……定盤 | 11……摺動面 |
| 12, 12a……X軸ガイド | |
| 13, 13a……Y軸ガイド | |
| 2……X軸可動ガイド | 24……長孔 |
| 21……ガイド部材 | 3……Y軸可動ガイド |
| 31……ガイド部材 | 4……ステージ |

【第1図】

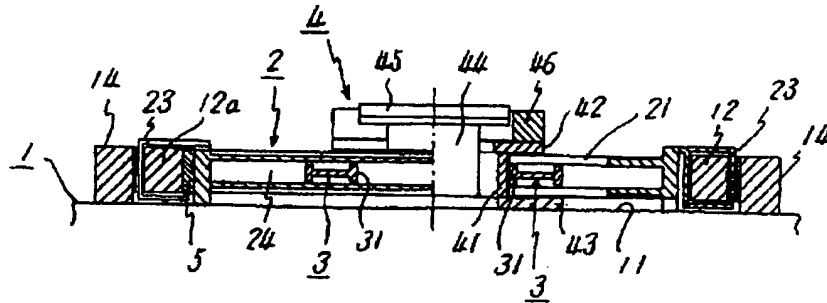
本発明にかかるXYステージの平面図



- | | | | |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| 1……定盤 | 11……摺動面 | 12, 12a……X軸ガイド | 13, 13a……Y軸ガイド |
| 2……X軸可動ガイド | 21……ガイド部材 | 24……長孔 | |
| 3……Y軸可動ガイド | 31……ガイド部材 | 4……ステージ | |

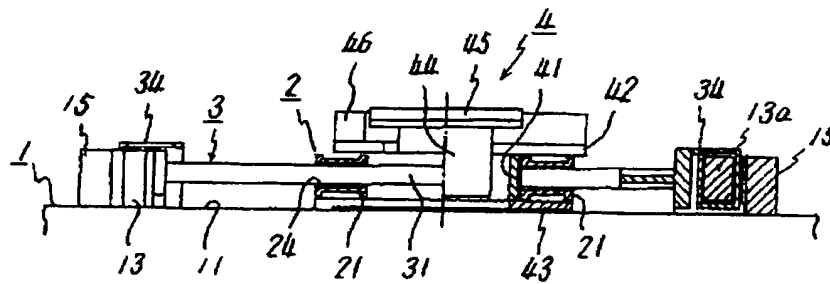
【第2図】

図1図中II-II線断面図



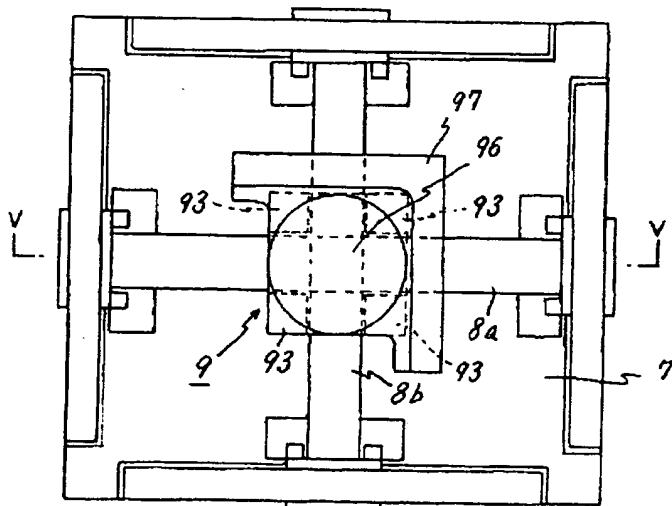
【第3図】

図1図中III-III線断面図



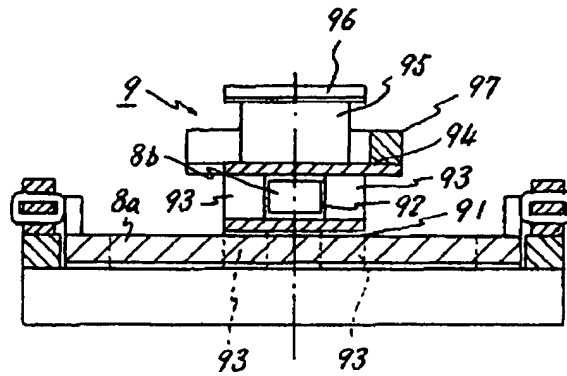
【第4図】

従来XYステージの平面図



【第5図】

図4のV-V線断面図



【第6図】

従来のXY可動カイドの
交叉部分の斜視図